

多目的X線回折装置

令和5年3月下旬導入予定

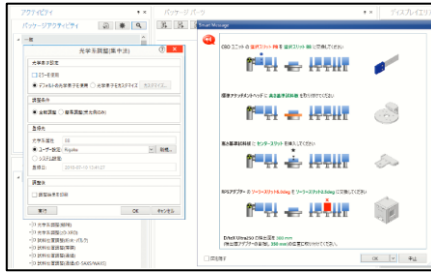
仕様

- **X線源**
回転対陰極式（ターゲット：Cu） 9kW
- **ゴニオメーター**
θ-θ型試料水平方式
- **検出器**
2次元ピクセル型半導体検出器
- **駆動軸**（※使用アタッチメントによる）
 $\theta_s, \theta_d, 2\theta, \varphi, \chi, X, Y, Z, R_x, R_y$

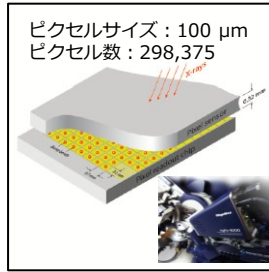


特徴

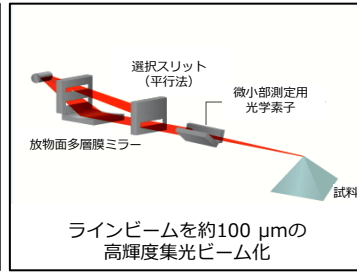
1台で粉末X線回折測定、微小部測定（約100 μm）、薄膜測定（インプレーン測定を含む）、残留応力測定、透過／反射小角・広角散乱測定が可能なX線回折装置です。



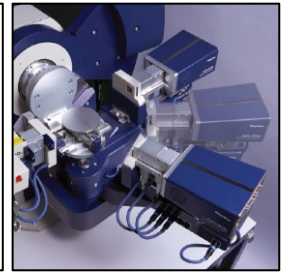
ユーザーガイダンス機能



検出器HyPix-3000



微小部光学系CBO-μ



インプレーンアーム

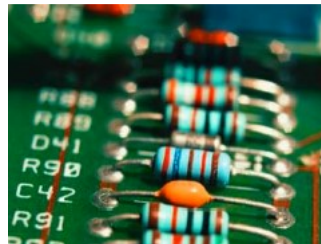
活用事例



半導体関連分野
精密薄膜の評価



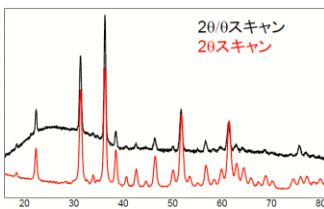
金属関連分野
残留応力の評価



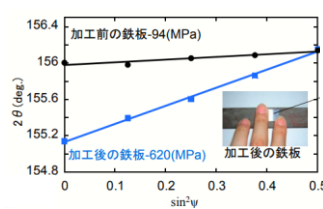
電気・電子分野
微小構成部品の評価



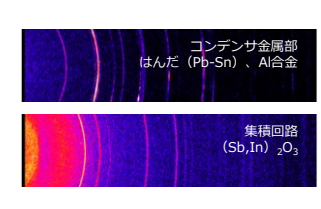
樹脂関連分野
フィルム配向度等の評価



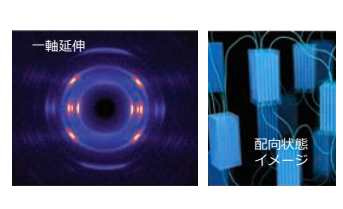
透明導電膜ITOの測定例



鉄板の残留応力の測定例



基板上的の構成部品の測定例



ポリプロピレンフィルムの測定例